

Monthly User Guide from JMP Korea

제 11호 (2018년 6월)

측정 시스템 분석(Gauge R&R)



- * 본 Guide 는 매월 세 번째 수요일에 발행됩니다.
- ** Monthly User Guide 지난 호는 다음 Site 를 참조하세요.
https://www.jmp.com/ko_kr/newsletters.html
- *** 본 Guide 의 내용과 관련한 문의는
Ikju.Shin@jmp.com 으로 연락 바랍니다

측정 시스템 분석(MSA : Measurement System Analysis)

JMP에서 구현되는 측정 시스템 Platform은 아래와 같습니다.

4가지 Case를 기준으로 JMP의 측정 시스템 Platform 중 JMP User들이 주로 많이 사용하는 부분[기능]을 소개하겠습니다

1. Analyze / Quality and Process / Measurement Systems Analysis

- 1) EMP Method 와 AIAG Method 지원
- 2) EMP(Evaluating the Measurement Process) 방법은 Donald J. Wheeler's의 방법을 기준으로 함
(EMP using Imperfect Data : 2006)

Case 1 : EMP 방법

Case 2 : AIAG 방법

2. Analyze / Quality and Process / Variability, Attribute Gauge R&R Chart

- 1) Chart를 이용하여 산포의 원인 분석
- 2) 범주형 측정결과(정성 평가 등)에 대한 측정 시스템 분석
- 3) Gauge Bias 및 Linearity 분석

Case 3 : Attribute Gauge R&R

Case 4 : Gauge Linearity 분석

* 본 자료에서는 Help / Sample Data Platform / Sample files categorized by type of analysis 의 'Measurement Systems'의 Sample Data를 활용하였음

** MSA는 경우에 따라, MCA(Measurement Capability Analysis), Gauge Study, Repeatability and Reproducibility (R&R) Study, Interlaboratory Uniformity (ILU) Study, Method Validation 및 Round Robin Study 등의 다양한 이름으로 불리웁니다

Measurement Systems	
2 Factors Crossed	Variability_Chart; MSA
2 Factors Nested	Variability_Chart; MSA
3 Factors Crossed	
3 Factors Crossed & Nested	Variability Chart
3 Factors Nested	
3 Factors Nested & Crossed	Variability Chart
Attribute Gauge	Attribute Chart
Gasket	Variability Chart, MSA
MSALinearity	Variability Chart
One Main Effect	
Wafer	MSA

Case 1 : EMP 방법

1. Sample file : wafer.jmp

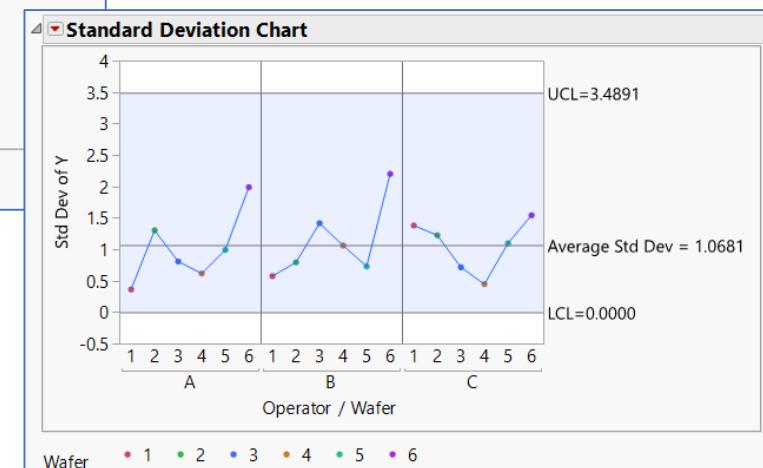
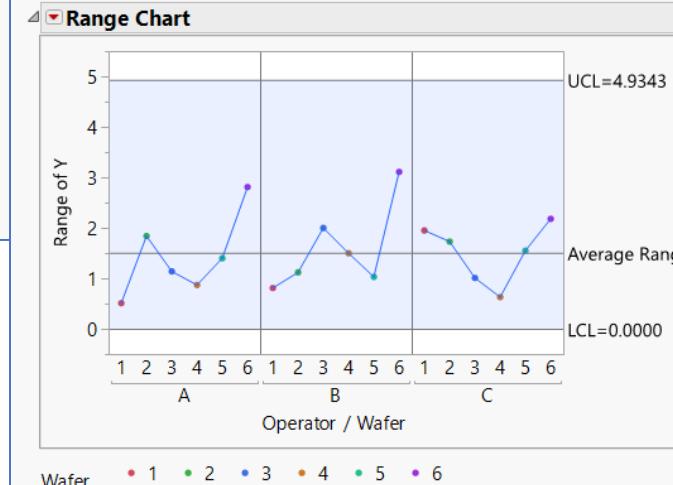
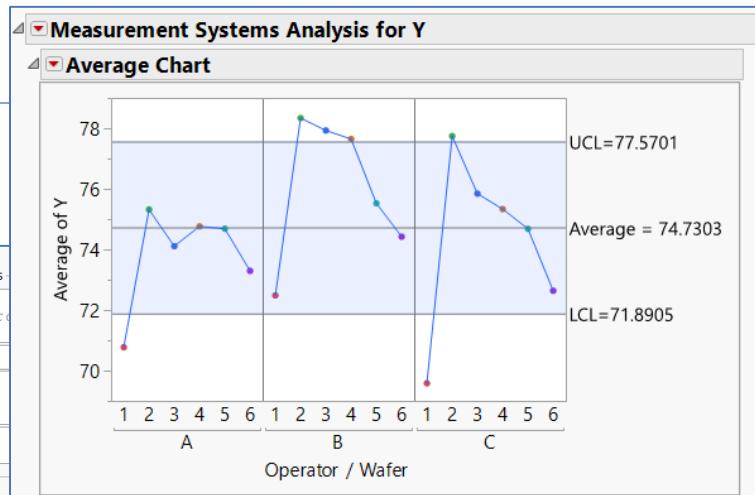
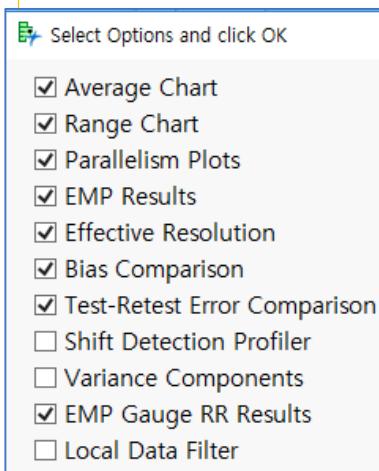
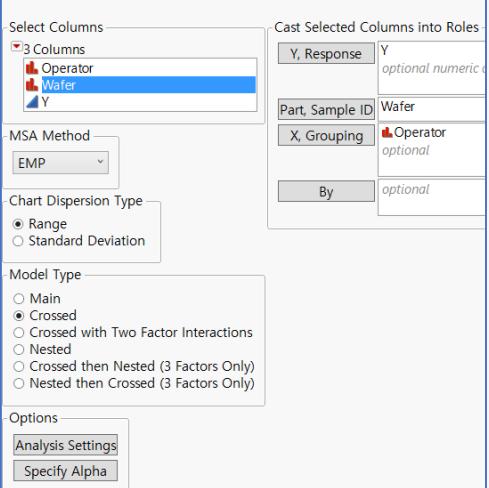
- 3명이 6개의 Sample에 대해 2회 반복 측정
- 3명*6개*2회 = 36 개의 data

2. 입력 화면

- 오른쪽과 같이 입력하고
- MSA Method에서 'EMP' 선택
- Chart Dispersion Type에서 'Range' 선택
- Modeling Type에서 'Crossed' 선택 (교호 작용을 확인하기 위해서 보통 'Crossed'를 선택)

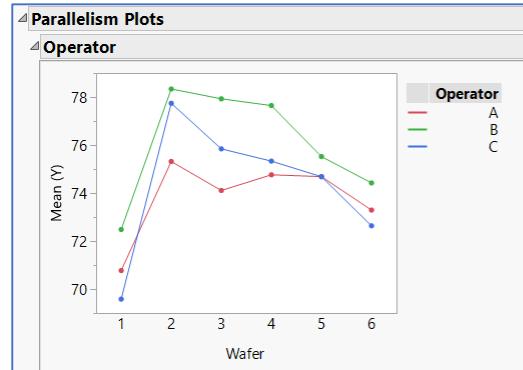
3. JMP에서는 Default로 Average Chart 와 Range Chart를 보여줍니다.

- 추가적으로 JMP User들은 아래와 같은 분석 방법을 이용하여 측정 시스템을 분석합니다 (빨간색 역삼각형에 마우스를 위치한 다음, Alt key + 마우스 Click하면 하위 Option이 모두 Display 됩니다. 아래처럼 선택 후 OK Click)

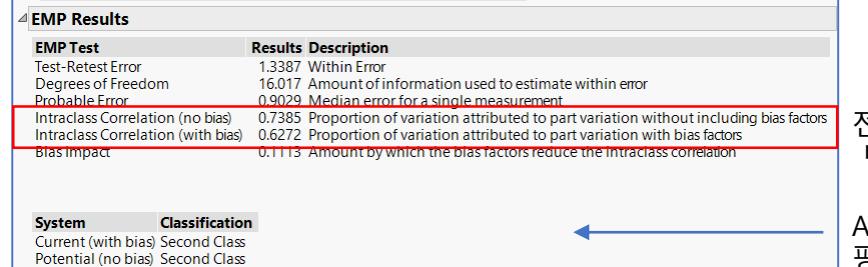


(Chart Dispersion Type에서 'Standard Deviation' 선택하였을 경우)

Case 1 : EMP 방법

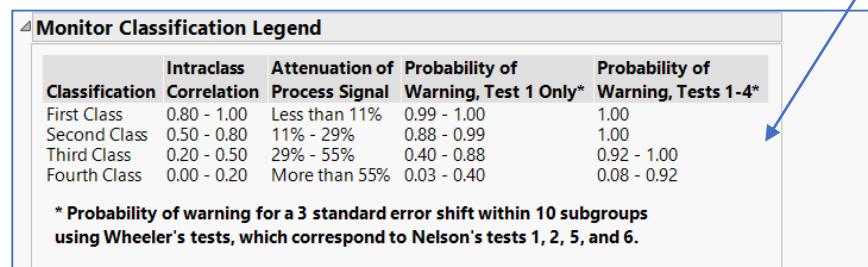


세 명의 측정결과에 대한
Graph Pattern 이 다르므로
교호작용이 존재함

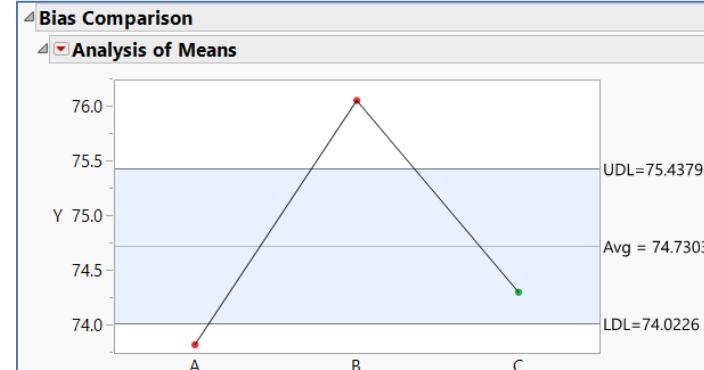


전체 변동에서 측정 대상간
변동이 차지하는 비율

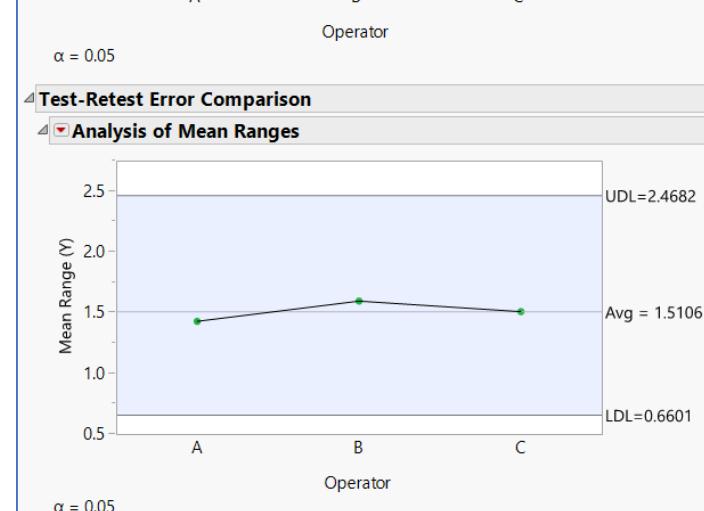
AMP 방법에서 측정 시스템을
평가하는 지표



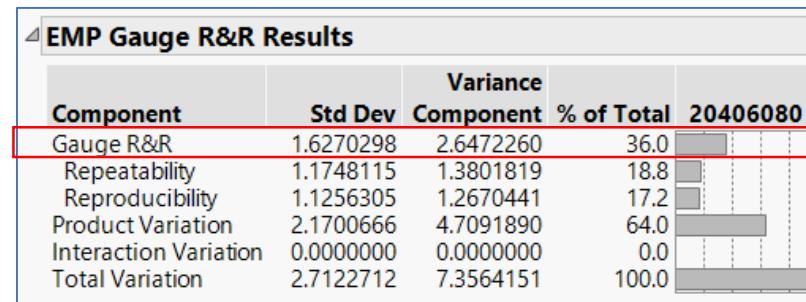
측정 시스템의 분해능
(Resolution)에 대한
평가. 최소 측정단위가
0.01 이 적당함을 알려줌



전체 평균 대비 각 측정자의 평균이
얼마나 차이 나는지를 보여줌



반복 측정한 값의 범위 평균으로
측정 시스템의 반복성을 나타냄



%Contribution 값이
36%로 측정 시스템으로서
적당하지 않음을 나타냄

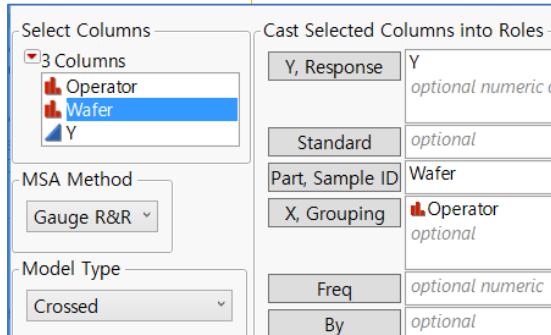
Case 2 : AIAG 방법

1. Sample file : wafer.jmp

- 3명이 6개의 Sample에 대해 2회 반복 측정
- 3명*6개*2회 = 36 개의 data

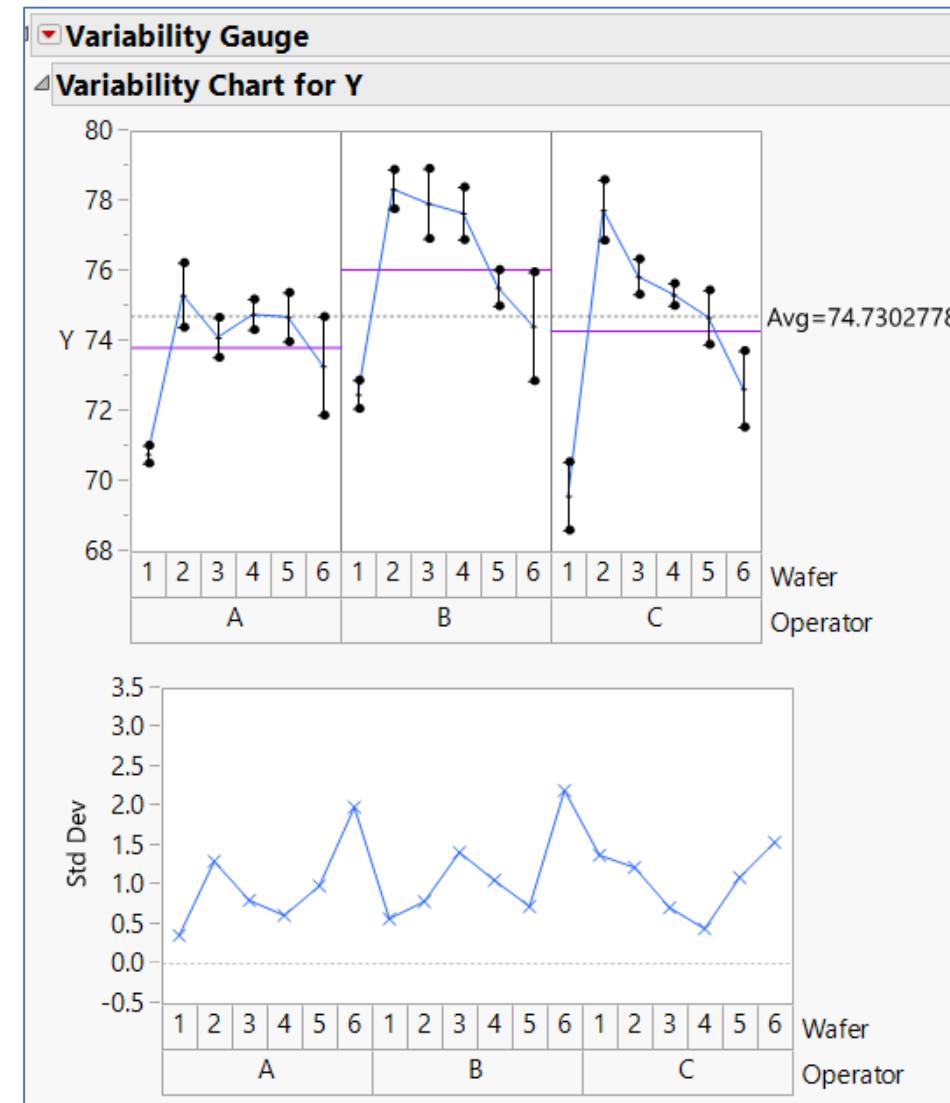
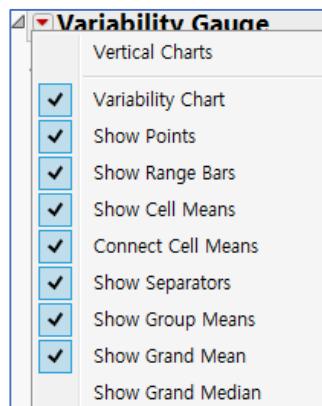
2. 입력 화면

- 오른쪽과 같이 입력하고
- MSA Method에서 'Gauge R&R' 선택
- Modeling Type에서 'Crossed' 선택



3. Variability Chart 가 Display 됨

가시성을 높이기 위해 빨간색 역삼각형 클릭,
Connect Cell Means, Show Group Means 와
Show Grand Mean 을 선택



전체 평균과 각 측정자의 평균을 볼 수 있음

반복 측정한 값을 선으로 연결하였으므로,
선의 길이가 길수록
반복성에 의한 산포가
크다고 말할 수 있음

반복 측정한 값의 편차를
계산하여 그린 그래프

Case 2 : AIAG 방법

4. 빨간색 역삼각형 클릭,
Gauge Studies / Gage R&R 클릭

<참고 : 측정 시스템 평가 기준>

평가지표	식	우수	양호	부족
%Contribution (%기여율)	$\frac{\sigma_{RR}^2}{\sigma_{TV}^2} \times 100\% (\%)$	1% 미만	1~9%	9% 이상
%Study Variation (%연구 변동)	$\frac{\sigma_{RR}}{\sigma_{TV}} \times 100\% (\%)$	10% 미만	10~30%	30% 이상
%Tolerance (%공차비)	$\frac{6\sigma_{RR}}{USL - LSL} \times 100\% (\%)$	10% 미만	10~30%	30% 이상
NDC* (구별 범주의 수)	$\left\lfloor \frac{\sigma_{PV}}{\sigma_{RR}} \times \sqrt{2} \right\rfloor$	10 이상	4~9	4 미만

Enter/Verify Gauge R&R Specifications

Choose tolerance entry method: K, Sigma Multiplier [e.g. 6 gives a 99.73% spread]

Tolerance Interval: 6

Tolerance Interval, USL-LSL, optional

Spec Limits, optional

Historical Mean, optional

Historical Sigma, optional

OK Cancel Help

Gauge R&R

Measurement Source	Variation (6*StdDev)	which is 6*sqrt of
Repeatability (EV)	6.333018	Equipment Variation
Reproducibility (AV)	5.316500	V(Within) + V(Operator)
Operator	4.431396	V(Operator)
Operator*Wafer	2.937330	V(Operator*Wafer)
Gauge R&R (RR)	8.268754	V(Within) + V(Operator) + V(Operator*Wafer)
Part Variation (PV)	10.553139	V(Wafer)
Total Variation (TV)	13.406753	V(Within) + V(Operator) + V(Operator*Wafer) + V(Wafer)

6 k

61.676 % Gauge R&R = 100*(RR/TV)

0.78354 Precision to Part Variation = RR/PV

1 Number of Distinct Categories = 1.41(PV/RR)

Using last column 'Wafer' for Part

Variance Components for Gauge R&R

Component	Var	Component	% of Total
Gauge R&R	1.8992302	38.04	20406080
Repeatability	1.1140865	22.31	
Reproducibility	0.7851437	15.73	
Part-to-Part	3.0935759	61.96	

%GRR(% Study Variance) : 62%
%Contribution : 38%
NDC(Number of Distinct Categories) : 1

→ 측정시스템으로서 부적합함

Case 3 : Attribute Gage R&R

0. 범주형 데이터에 대한 측정 시스템 분석에 사용

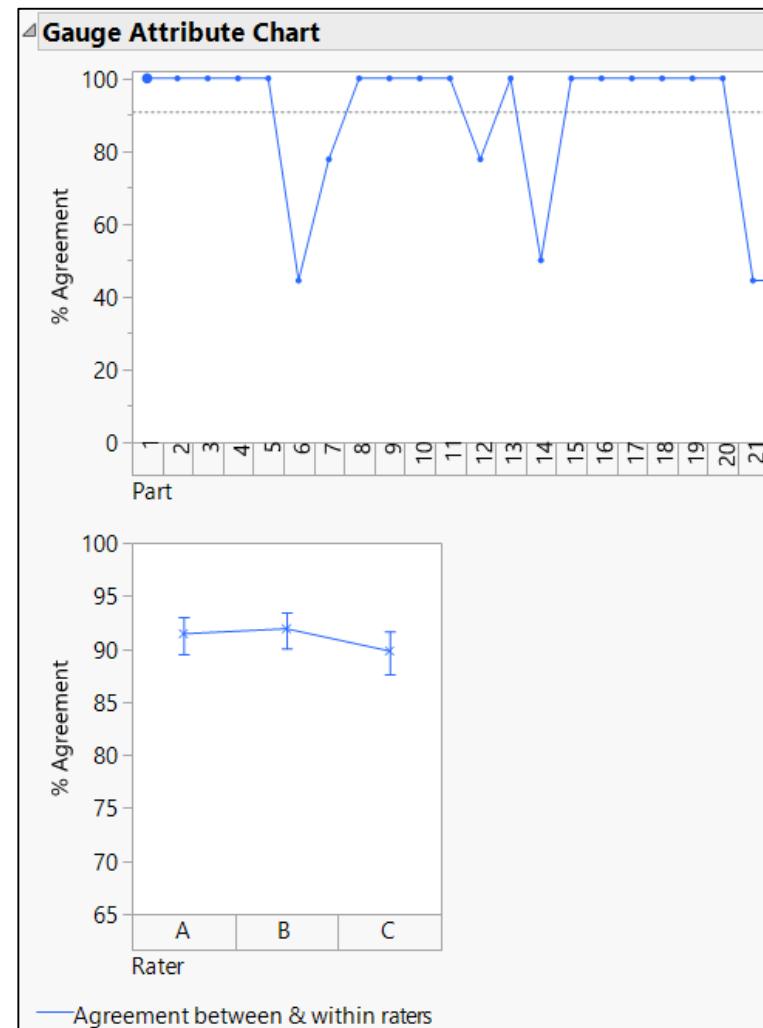
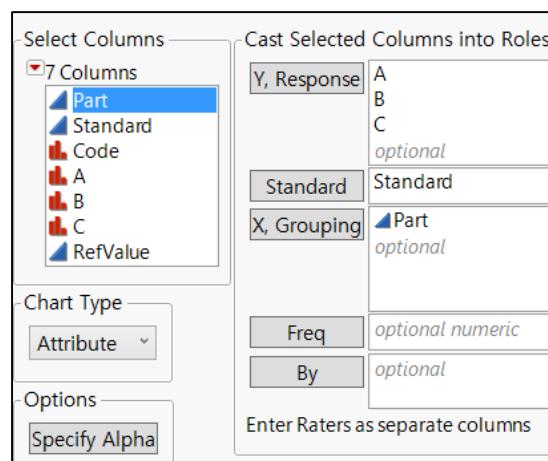
- 1) Pass or Fail
- 2) 몇 가지 범주로 분류하는 경우
- 3) 순서(등수) 매기는 경우 등

1. Sample file : attribute gauge.jmp

- 1) 50개 Sample에 대해 3명이 3번씩 반복측정
- 2) 측정결과는 양품, 불량으로 판정(0, 1)

2. 입력 화면

- 1) 아래와 같이 입력하고
- 2) Chart Type에서 'Attribute' 선택



각 부품별로 측정 일치도를 보여줌
(3명이 3회씩 반복 측정하였으므로
총 9회 중 일치하는 확률을 나타냄)

측정자별 일치도

Case 3 : Attribute Gage R&R

Agreement Report					
Rater	% Agreement	95% Lower CI	95% Upper CI		
A	91.4286	89.5082	93.0248		
B	91.9048	90.0502	93.4388		
C	89.8095	87.6057	91.6588		

Number Inspected	Number Matched	% Agreement	95% Lower CI	95% Upper CI	
50	39	78.000	64.758	87.246	

Agreement Comparisons							
Compared with Rater		Kappa	.2	.4	.6	.8	Standard Error
A	B	0.8629					0.0442
A	C	0.7761					0.0547
B	C	0.7880					0.0537

Compared with Standard							
Rater	Compared with Standard	Kappa	.2	.4	.6	.8	Standard Error
A	Standard	0.8788					0.0416
B	Standard	0.9230					0.0338
C	Standard	0.7740					0.0551

Agreement within Raters					
Rater	Number Inspected	Number Matched	Rater Score	95% Lower CI	95% Upper CI
A	50	42	84.0000	71.4858	91.6626
B	50	45	90.0000	78.6398	95.6524
C	50	40	80.0000	66.9629	88.7562

Agreement across Categories							
Category	Kappa	.2	.4	.6	.8	Standard Error	
0	0.7936					0.0236	
1	0.7936					0.0236	
Overall	0.7936					0.0236	

일반적으로 Kappa 통계량이 60% ~ 70% 이상이면 측정시스템이 괜찮다고 판단 (Kappa 통계량 : 평가자간 평가 결과의 일치도를 계산하는 지표 중의 하나)

Effectiveness Report								
Agreement Counts								
Rater	Correct(0)	Correct(1)	Total Correct	Incorrect(0)	Incorrect(1)	Grand Total		
A	45	97	142	3	5	150		
B	45	100	145	3	2	150		
C	42	93	135	6	9	150		

Effectiveness				
Rater	Effectiveness	95% Lower CI	95% Upper CI	Error rate
A	94.6667	89.8296	97.2730	0.0533
B	96.6667	92.4348	98.5680	0.0333
C	90.0000	84.1565	93.8459	0.1000
Overall	93.7778	91.1542	95.6603	0.0622

Misclassifications					
Standard Level	0	1			
0	.	16			
1	12	.			
Other	0	0			

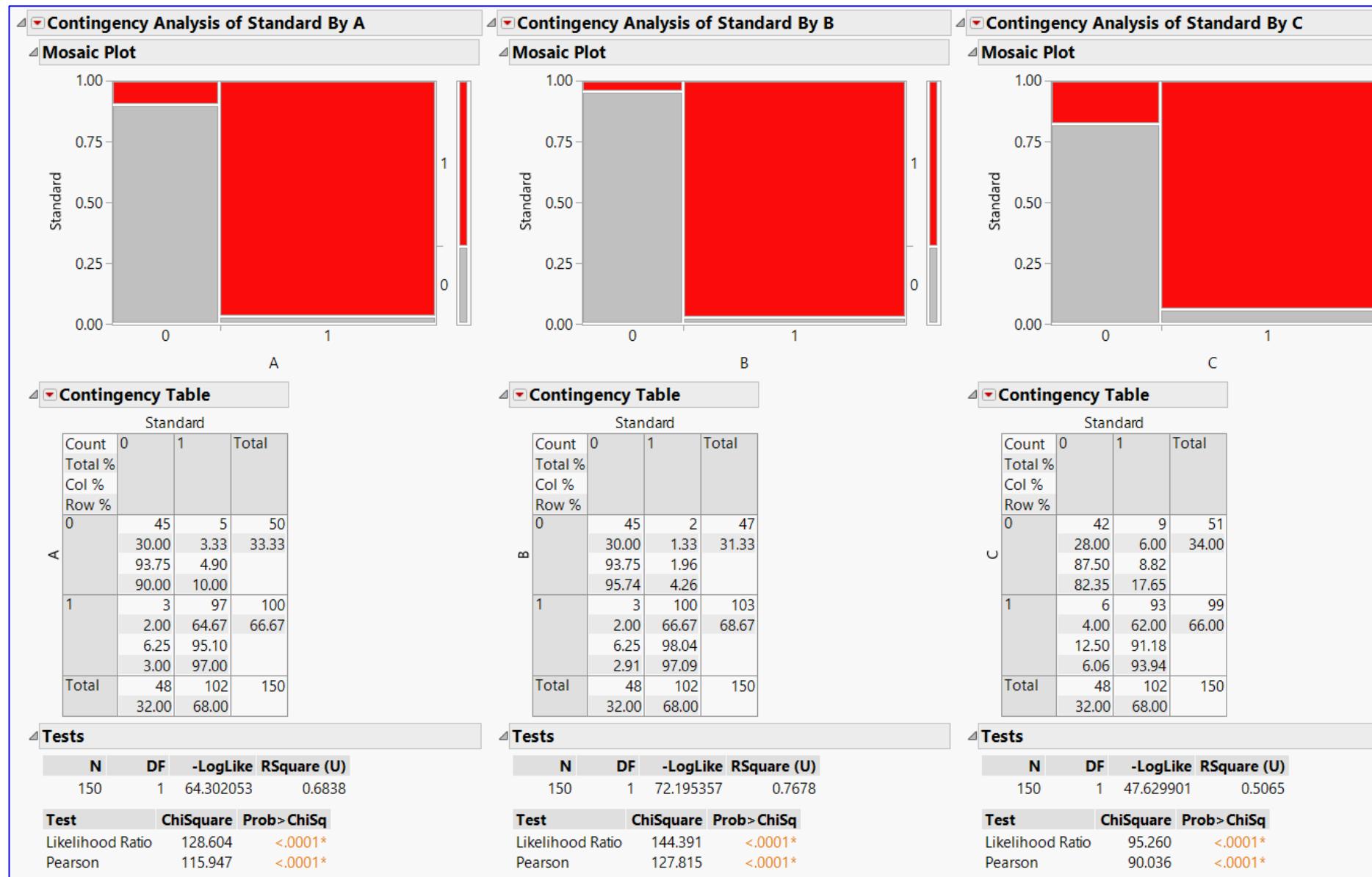
Conformance Report					
Rater	P(False Alarms)	P(Misses)	Assumptions		
A	0.0490	0.0625	NonConform = 0		
B	0.0196	0.0625	Conform = 1		
C	0.0882	0.1250			

평가자별 일치도

P(False Alarms) : 1종 오류
P(Misses) : 2종 오류

Case 3 : Attribute Gage R&R

참고 : Analyze / Fit Y by X Platform 을 이용해서도 유사한 결과를 확인할 수 있다



Case 4 : Gauge Linearity

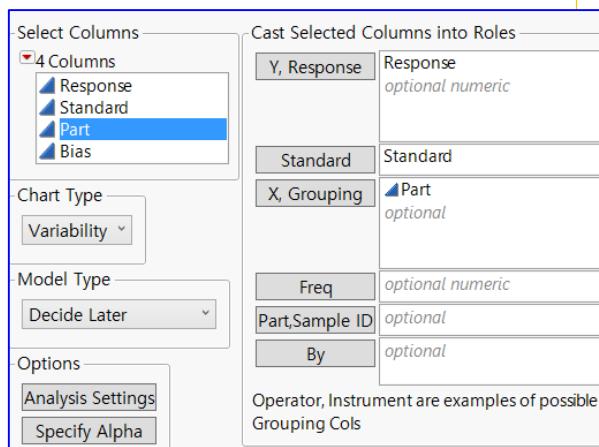
0. 측정 값의 전체 범위에 대해 참값과 측정값의 차이가 있는지, 즉 편의(Bias)에 대한 평가

1. Sample file : MSAlinearity.jmp

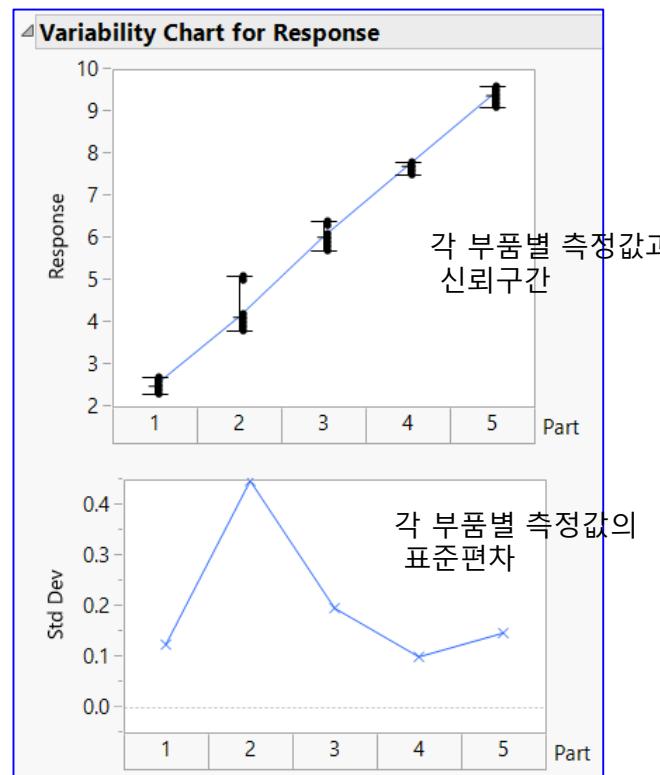
- 1) 50개 Sample에 대해 3명이 3번씩 반복측정
- 2) 측정결과는 양품, 불량으로 판정(0, 1)

2. 입력 화면

- 1) 아래와 같이 입력하고
- 2) Chart Type에서 'Variability' 선택

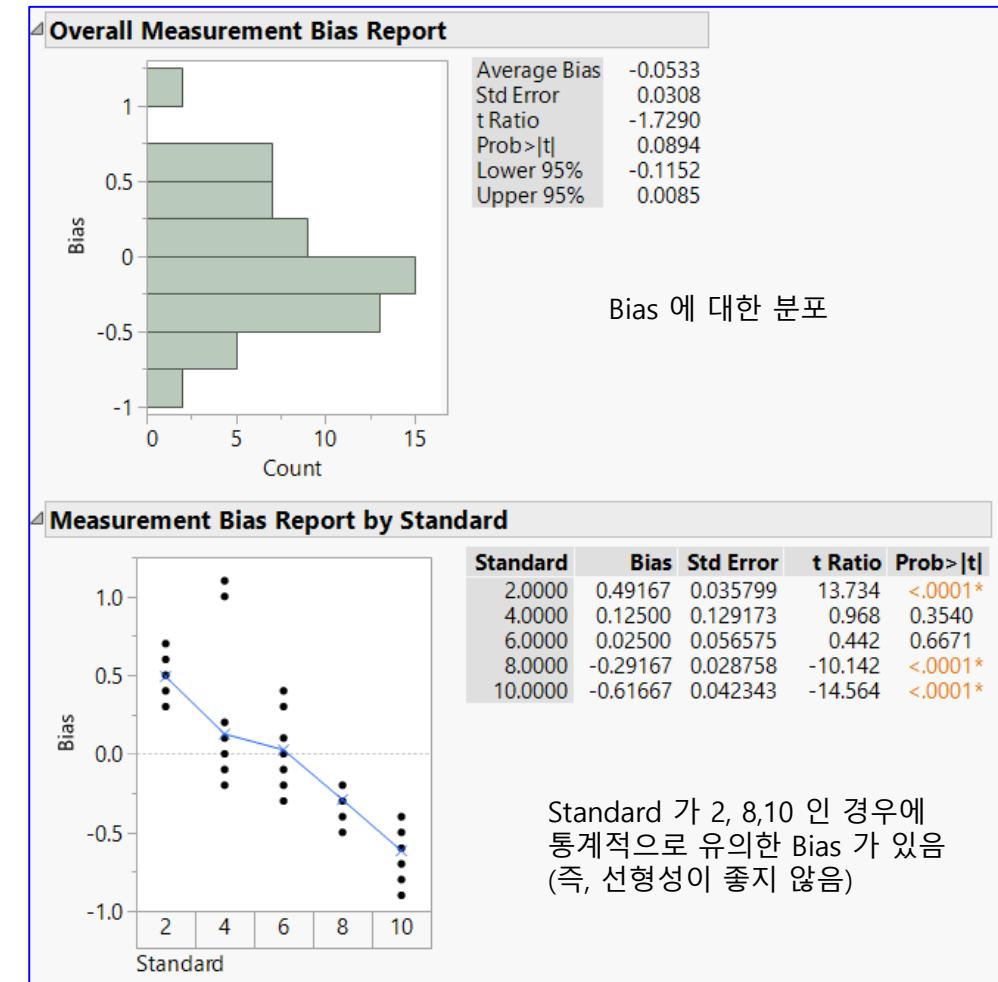


3. 빨간색 역삼각형에서 Gauge Studies / Bias Report 클릭



각 부품별 측정값과 신뢰구간

각 부품별 측정값의 표준편차



Bias에 대한 분포

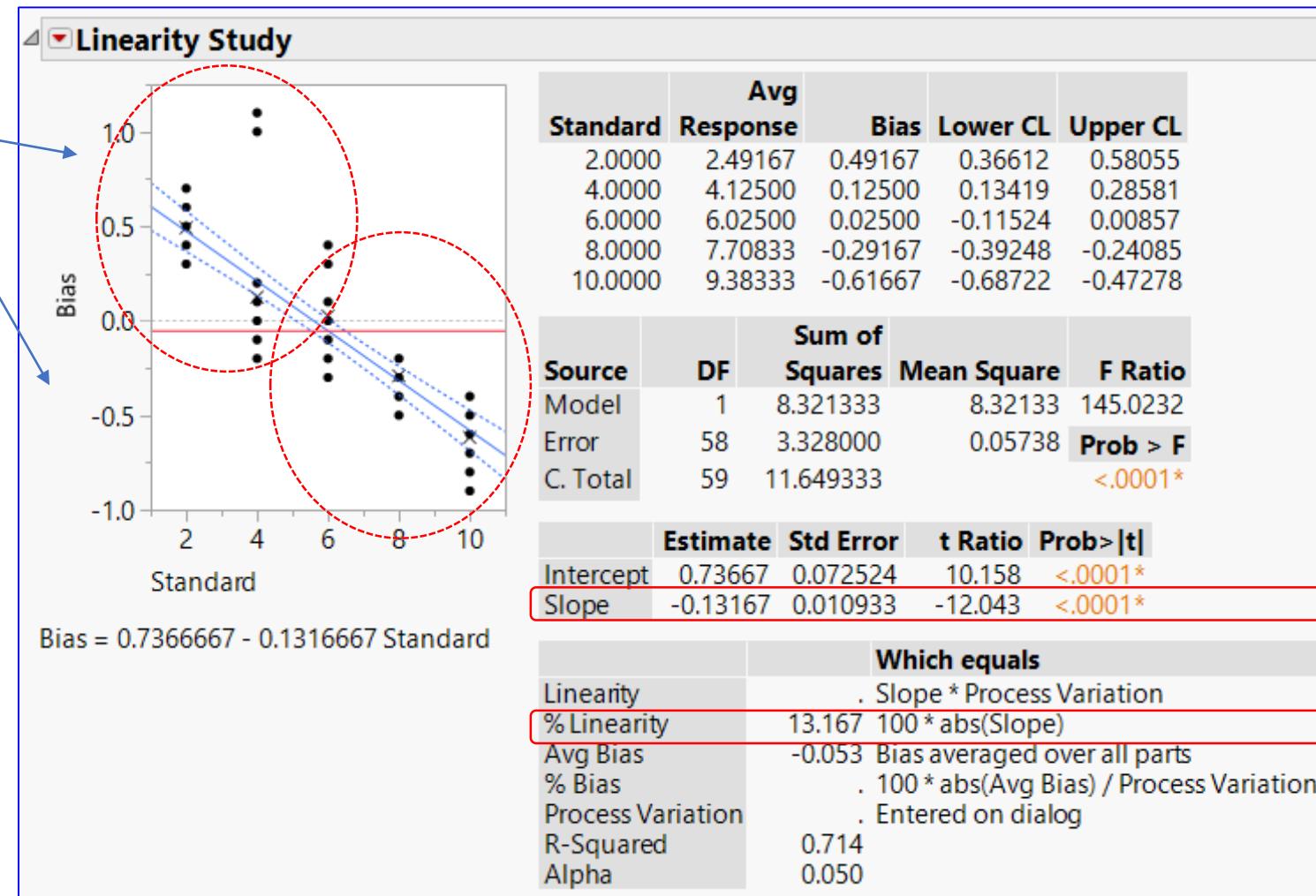
Standard 가 2, 8, 10 인 경우에 통계적으로 유의한 Bias 가 있음 (즉, 선형성이 좋지 않음)

Case 4 : Gauge Linearity

4. 빨간색 역삼각형에서 Gauge Studies / Linearity Study 클릭

작은 값에서는 치우침이 양수로,
(실제 값보다 높게 측정된다는 뜻)

큰 값에서는 치우침이 양수로 나타남
(실제 값보다 작게 측정된다는 뜻)



기울기가 -0.13이고, P값이
통계적으로 유의하므로
측정 구간 내의 선형성이 좋지 않음

% Linearity 가 13.167% 임
(보통 10% 이상이면 선형성이
좋지 않다고 판단)